06

Получение высоких уровней легирования Mn в алмазоподобном полупроводнике ZnGeP₂ методом диффузии в твердой фазе

© С.И. Голощапов, С.Е. Никитин

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, С.-Петербург E-mail: stanislav.goloshchapov@mail.ioffe.ru

Поступило в Редакцию 23 января 2007 г.

Методом реактивной диффузии в твердой фазе получены высокие уровни легирования марганцем кристаллов халькопирита ZnGeP₂. Измерения сигнала ЭПР показали, что концентрация Mn^{2+} составляет $10^{17} - 10^{18}$ cm⁻³.

PACS: 81.05.Hd, 82.56.Lz

Проблема создания магнитных материалов на основе традиционных алмазоподобных полупроводников существует довольно давно [1]. Создание таких материалов могло бы открыть возможности для создания принципиально новых магнитоэлектрических устройств. Хорошо известно, что главной проблемой получения алмазоподобного полупроводника с ферромагнитными свойствами является сложность получения концентрированных твердых растворов (> 0.01 at.%) переходного металла в алмазоподобном полупроводнике. Одной из попыток преодоления этих трудностей было создание DMS (deluted magnetic semiconductors) на основе систем II-VI и III-V, допированных переходным металлом (Cd_{1-x}Mn_xTe, а также Ga_{1-x}Mn_xAs) [2,3]. В работе [4] сообщается о наблюдении ферромагнетизма в системе II-IV-V₂, легированной марганцем, — Cd_{1-x}Mn_xGeP₂. Однако эти материалы оказались недостаточно пригодными для практических применений, например, $Ga_{1-x}Mn_xAs$, хотя и демонстрирует ферромагнитные свойства, но температура Кюри слишком низка (≈ 150 К). Отметим, что выбор Mn в качестве легирующей примеси связан прежде всего с тем, что марганец способен проявлять несколько валентностей, характеризующихся

34

различными зарядовыми и спиновыми состояниями (в частности, Mn^{+3} и Mn^{+2}) и различными ионными радиусами [5].

Эксперимент и обсуждение результатов. Целью настоящей работы является достижение высоких уровней легирования марганцем алмазоподобного полупроводника ZnGeP2 со структурой халькопирита методом диффузии в твердой фазе. Количество ионов марганца в кристаллах ZnGeP2 определялось с помощью методики ЭПР. Рассмотрим основные проблемы, возникающие в процессе легирования кристалла ZnGeP2 марганцем. При получении монокристаллов ZnGeP2: Мп путем добавления марганца при синтезе либо в ростовую шихту возникают трудности, связанные с недостаточной изученностью четырехкомпонентной системы Zn-Ge-P-Mn. Прежде всего это связано с возможностью образования нескольких фаз, включающих в себя переходный металл, который может проявлять несколько валентных состояний. Такими фазами могут быть: твердый раствор марганца в $Zn_{1-x}Mn_xGeP_2$; тройные соединения, например, MnGeP₂, кроме того, в процессе синтеза и роста монокристаллов возможно образование ряда двойных соединений марганца с фосфором (MnP, Mn₃P, Mn₂P) [6]. Серьезной проблемой является также высокое равновесное давление паров над ZnGeP₂ вблизи точки плавления (> 1 atm) [7,8]. Эти трудности заставляют искать более простые и технологичные пути получения кристаллов ZnGeP₂ с высокой концентрацией Мп. Одним из таких путей может быть диффузия переходного металла (Mn) из тонкого слоя, осажденного на монокристаллическую подложку ZnGeP₂. Диффузия марганца и других переходных металлов всегда связана с проведением процесса при повышенных температурах (> 770 К). Это необходимое условие накладывает ограничения на технологию диффузии, поскольку ZnGeP₂ имеет достаточно высокое равновесное давление собственных паров. Зависимость давления насыщенных паров над ZnGeP₂ и их состав в интервале 940 ÷ 1270 К исследованы в работах [7,8]. Равновесное давление паров цинка и фосфора над ZnGeP2 растет экспоненциально с температурой и при 1080 К равно \approx 10 Torr, а при 1200 К превышает 760 Torr. Состав пара — 70 at.% фосфора и 30 at.% цинка. Германия в паровой фазе не обнаружено. Из этих данных следует, что процесс диффузии желательно проводить при температурах, когда давление паров цинка и фосфора над ZnGeP2 сравнительно мало, что обусловлено необходимостью максимального сохранения химического состава монокристалла ZnGeP2. Поэтому был выбран компромиссный вариант,

3* Письма в ЖТФ, 2007, том 33, вып. 16

когда температура, при которой протекала диффузия, находилась в интервале 770-1080 К. Экстраполяция зависимости общего равновесного давления над ZnGeP2 к этому температурному интервалу дает значения давления $\approx 10^{-1}$ –10 Torr. Давление паров марганца при таких температурах мало. Очевидно, что проведение диффузии марганца в ZnGeP₂ при температурах выше 800 К в той же камере, где проводилось осаждение металла, не технологично. Поэтому возможны два варианта процесса диффузии Mn в ZnGeP₂: первый — проведение диффузии в отдельном реакторе с непрерывной откачкой, второй вариант проведение диффузии в откачанных и запаянных кварцевых ампулах. Эксперименты проводились на небольших монокристаллических образцах ZnGeP₂ размером $7 \times 2 \times 2$ mm, предварительно ориентированных методом рентгеновской диффракции. Осаждение слоев осуществлялось при остаточном давлении 10^{-5} Torr на подложки, находившиеся при комнатной температуре. Толщина слоя марганца измерялась на стеклянном образце-свидетеле и составляла от 100 до 500 nm. Первоначально опыты по диффузии марганца проводились по первому варианту. На образцы осаждалась пленка марганца толщиной ~ 100 nm. Затем образец помещался в отдельный реактор и отжигался под непрерывной откачкой (10⁻⁴ Torr) по следующей схеме: плавный нагрев в течение 0.5 h до температуры 800 К с последующей выдержкой при этой температуре в течение 60 min и последующим медленным (\approx 90 min) охлаждением до комнатной температуры. В этих образцах интенсивность сигнала ЭПР Mn²⁺ соответствовала 10¹²-10¹³ спинов, что характерно для естественной концентрации примеси. Во второй серии образцов осаждение марганца проводилось в аналогичных условиях. Отжиг также проводился в отдельном реакторе под непрерывной откачкой (10^{-4} Torr) и за те же времена, но максимальная температура отжига составляла 920 К. Интенсивность сигнала ЭПР Mn²⁺ в этих образцах возросла на порядок. Эти результаты показали, что для увеличения концентрации марганца необходимо заметно поднять температуру.

Отрицательным фактором при отжиге с непрерывной откачкой является нарушение стехиометрии поверхностных слоев ZnGeP₂. Отжиг в атмосфере инертного газа (Ar) приводит к аналогичным результатам, поскольку существенным является парциальное давление цинка и фосфора. Поэтому мы остановились на варианте проведения процесса диффузии в откачанных и запаянных кварцевых ампулах. Эта методика позволяет существенно уменьшить влияние сублимации при высоких

Письма в ЖТФ, 2007, том 33, вып. 16

$$n_{\rm Mn} = \{(v \times \rho)/A\} \times N_A \approx 2.5 \cdot 10^{17} \, {\rm at.}$$

где v — объем пленки; $\rho = 7.44 \text{ g/cm}^3$ — плотность марганца; A = 54.94 — атомная масса марганца; $N_A = 6.02 \cdot 10^{23}$ — число Авогадро.

Число молекул остаточных газов n_g в ампуле объемом $V = 2 \,\mathrm{cm}^3$ при давлении $P_1 = 10^{-4}$ Torr

$$n_g = (L \times V) P_1 / P_2 \approx 8 \cdot 10^{12} \text{ mol.},$$

где $L \approx 3 \cdot 10^{19}$ — число молекул идеального газа в 1 cm^3 при 273 К и атмосферном давлении $P_2 = 760$ Torr. Аналогичные расчеты показывают, что при равновесном давлении паров цинка и фосфора над ZnGeP₂ ≈ 10 Torr в ампуле объемом $V = 2 \text{ cm}^3$ будет содержаться $\approx 8 \cdot 10^{17}$ атомов Zn и P, с преимущественным содержанием фосфора. Это составляет примерно 10^{-2} at.% от общего количества атомов в исходном кристалле ZnGeP₂. Соответственно в кристалле дополнительно образуется равное количество вакансий цинка и фосфора, что помимо высокой температуры должно способствовать диффузии марганца. Таким образом, процесс отжига в ампуле сводился к диффузии металла в кристалл и взаимодействию его с парами цинка и фосфора, выделяющимися из ZnGeP2. Это обстоятельство приводит к возникновению двух конкурирующих факторов — медленного процесса диффузии металла в ZnGeP2 и преобладающей химической реакцией между марганцем и фосфором. Эта реакция приводит к образованию слоя фосфидов на внешней стороне пленки марганца, который служит препятствием для взаимодействия диффундирующего марганца с парами фосфора и цинка. Отметим, что для переходных металлов характерна ретроградная растворимость в алмазоподобных полупроводниках. Одним из способов сохранения метастабильного состояния четверной системы Zn-Ge-P-Mn с высокой концентрацией марганца может быть быстрое охлаждение до комнатной температуры. Учитывая эти соображения, третья серия образцов приготавливалась следующим образом: по указанной выше технологии на монокристалл ZnGeP2

Письма в ЖТФ, 2007, том 33, вып. 16

осаждался слой марганца (≈ 500 nm). Затем образцы помещались в кварцевые ампулы, которые вакуумировались до остаточного давления $5\cdot 10^{-5}$ Torr и запаивались. Ампулы с образцами отжигались при температуре 1080 К в течение 2 h и затем быстро охлаждались. В этой серии образцов наблюдался интенсивный сигнал ЭПР Mn²⁺, соответствующий $10^{16}-10^{17}$ спинов в образце. Отметим, что количество двухвалентного марганца в кристалле ZnGeP₂ сопоставимо с количеством марганца, содержавшегося в осажденной пленке.

Полученные результаты показывают, что методом реактивной диффузии в твердой фазе удалось достичь высоких $(10^{17}-10^{18}\,{\rm cm}^{-3})$ концентраций ионов марганца в монокристаллах ZnGeP₂.

Авторы приносят благодарность А.А. Вайполину и Т.Н. Ушаковой за содействие в работе.

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований по гранту № 05-02-17817.

Список литературы

- [1] Сюше Ж.П. Физическая химия полупроводников. М.: Металлургия, 1969.
- [2] Furdina J.K. // J. Appl. Phys. 1988. V. 64. P. R29.
- [3] Ohno H. // J. Electron. Lett. 1994. V. 30. P. 1954.
- [4] Medvedkin G., Takayuki Ishibashi, Takao Nishi, Koji Hayata, Yoshi Hasegava, Katsuaki Sato // Jpn. J. Appl. Phys. 2000. V. 39. P. L. 949–951.
- [5] Sato K., Katayama-Yoshida H. // Jpn. J. Appl. Phys. 2000. V. 39. P. 5555.
- [6] Самсонов Г.В., Верейкина Л.Л. Фосфиды. Киев: Изд. АН. УССР, 1961.
- [7] Борщевский А.С., Шанцовой Т.М. // Неорганические материалы. 1975. Т. 11. № 12. С. 2158–2161.
- [8] Buehler E., Vernick J.H.J. // J. Cryst. Growth. 1971. V. 4. P. 324.

Письма в ЖТФ, 2007, том 33, вып. 16